(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2003 年2 月20 日 (20.02.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/015149 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/31

(21) 国際出願番号: PCT/JP02/07974

(22) 国際出願日: 2002 年8 月5 日 (05.08.2002)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2001-240025 2001 年8 月8 日 (08.08.2001) JP
特願2001-338250 2001 年11 月2 日 (02.11.2001) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目３番６号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 坂本 浩一 (SAKAMOTO,Koichi) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目３番６号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 竹永 裕一 (TAKENAGA,Yuichi) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目３番６号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 横田 隆 (YOKOTA,Takashi) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目３番６号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 川村 和広 (KAWAMURA,Kazuhiro) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目３番６号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 吉武 賢次, 外(YOSHITAKE,Kenji et al.); 〒100-0005 東京都 千代田区 丸の内三丁目２番３号 富士ビル３２３号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

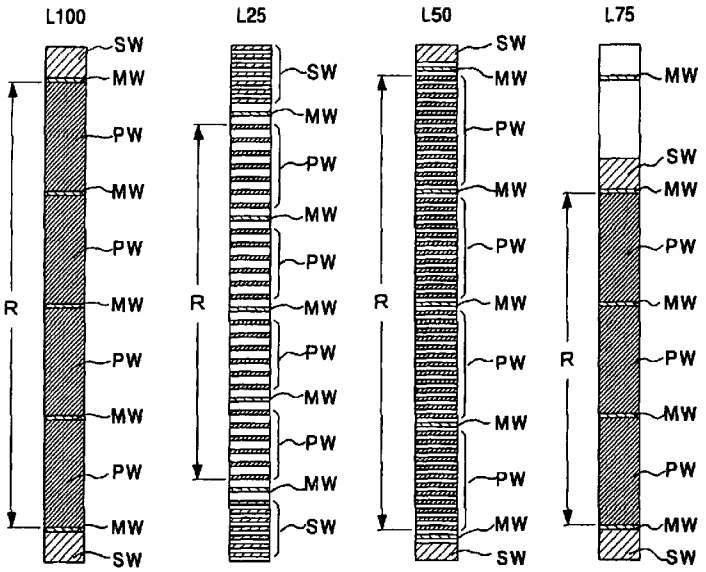
(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) **Title:** HEAT TREATMENT METHOD AND HEAT TREATMENT DEVICE

(54) 発明の名称: 熱処理方法および熱処理装置



(57) **Abstract:** A heat treatment method and a heat treatment device, the method comprising the steps of, when treated bodies of less quantity than the maximum treatable quantity thereof in a treated body holder are heat treated, specifying a heat treated body quantity range having the quantity of the treated bodies belonging thereto selectively from one or more treated body quantity ranges having a standard quantity less than the maximum treatable quantity in the treated body holder set as the maximum value, placing the treated bodies according to a placing pattern set in correspondence to the specified treated body quantity range, and heat-treating the treated bodies under the treating conditions pre-set according to the placing pattern; the heat treatment device comprising a controller for implementing the heat treatment method.

[続葉有]

WO 03/015149 A1

(57) 要約:

熱処理方法は、被処理体保持具における最大処理可能数より少ない数量の被処理体について熱処理を行う場合に、被処理体保持具における最大処理可能数より少ない基準数量が最大値として設定された１または２以上の被処理対数量範囲より、処理すべき被処理体の数量が属する被処理体数量範囲が指定される。この指定された被処理体数量範囲に対応して設定された載置パターンに従って被処理体が載置される。当該載置パターンに応じて予め設定された処理条件に従って熱処理が行われる。熱処理装置は、上記の熱処理方法を実行するための制御装置を備えてなる。